

● 「イメージ分光方式を用いた超高速全面膜厚測定技術の開発」

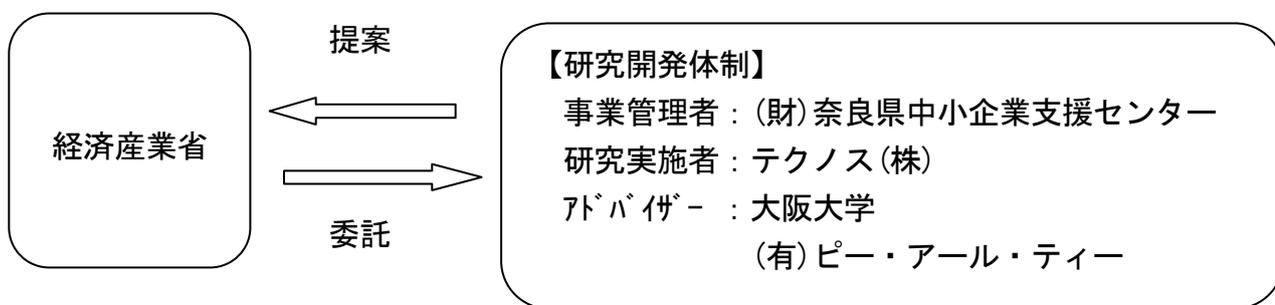
○研究開発の概要

液晶などのFPD産業では、近年のパネルの大型化に伴い、製品の品質、短納期、低コストへのニーズが高まっている。しかし、FPD製品の品質を左右する膜厚の均一性の検査は、いまだに人間の目視官能に頼っている現状がある。本事業では大幅な生産効率の向上を目指し、検査作業を人間の目に代わり機械で自動化する高度な組込み画像処理ソフトウェアを開発し、イメージ分光方式を用いた超高速全面膜厚測定技術を確立する。

○研究期間 平成24年3月末まで

○事業費（予定） 約45百万円（平成22年度）

○事業スキーム



〔研究内容の詳細については下記にお問い合わせ下さい。〕

テクノス(株) 開発部システム機器部 マネージャー 藤井 敏夫

TEL 0742-36-3389